

## 透過電子顕微鏡 JEM-2010

製造元	日本電子(株) 購入年度：2006年度
仕様	観察モード： TEMのみ (STEMなし) EDS分析： 不可 電子銃： LaB <sub>6</sub> 加速電圧： 200 kV 分解能 粒子像 (点分解能)： 0.23 nm 格子像： 0.14 nm 試料傾斜： Tilt-X ±35° Tilt-Y ±30°
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・地下1階020室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko</a>
注意事項等	予約可能範囲は2週間先までで、その範囲内で各人1枠のみ予約可能。
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 鹿住健司 075-753-5474 <a href="mailto:kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp">kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp</a>
キーワード	TEM、電子回折、格子欠陥観察
機器コード	0000103008
自由記入欄	一般的なTEM (Conventional TEM) である。 CCDカメラはサイドマウントであるため高分解能像の取得には不向き。 イオンミリング法によるTEM試料作製のための装置も利用可能である。

